

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 8 月 24 日 (2006.8.24)

【公開番号】特開 2001-330575 (P2001-330575A)

【公開日】平成 13 年 11 月 30 日 (2001.11.30)

【出願番号】特願 2001-76887 (P2001-76887)

【国際特許分類】

G 0 1 N 25/20 (2006.01)

G 0 1 K 19/00 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 25/20 J

G 0 1 K 19/00

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 18 年 7 月 5 日 (2006.7.5)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】図面

【訂正対象項目名】図 2 a

【訂正方法】追加

【訂正の内容】

【 図 2 a 】

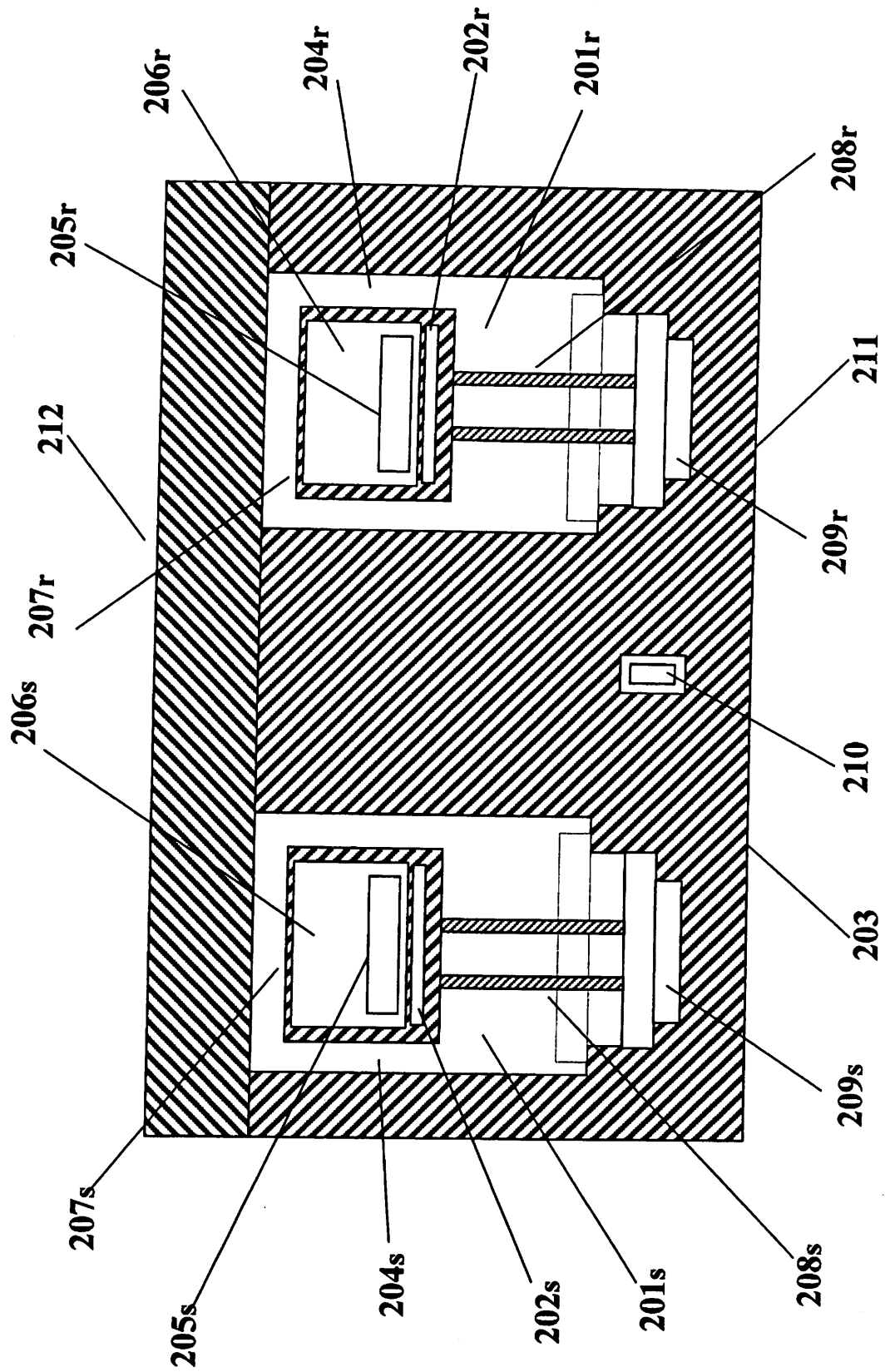


FIG. 2a

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】図面の簡単な説明

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 は、熱流束差分走査熱量計の熱ネットワークモデルである。

【図 1 a】

図 1a は、本発明の一実施形態の熱流束 D S C センサの略図である。

【図 1 b】

図 1b は、図 1 a に示すセンサの実施形態の断面図である。

【図 1 c】

図 1c は、図 1 a および図 1 b に示す熱電対が、本発明においてどのように絶対的温度および差分温度を測定するために用いられているかを示す接続図である。

【図 1 d】

図 1d は、本発明の好ましい実施形態のための D S C セルアセンブリの断面図である。

【図 2】

図 2 は、パワー補償差分走査熱量計の熱ネットワークモデルである。

【図 2 a】

図 2a は、本発明の実施形態によるパワー補償 D S C の概略ダイアグラムである。

【図 3】

図 3 は、以下で説明する、本発明にかかる改良された計算を用いて得られた熱流（曲線 3）と、従来の D S C s を用いて得られた熱流（曲線 1）と、および改良された計算なしで本発明を用いて得られた熱流（曲線 2）との比較を示すグラフである。

【図 4】

図 4 は、本発明における融解の開始時点のサンプルの温度、サンプル保持皿の温度、サンプルセンサの温度を示すグラフである。